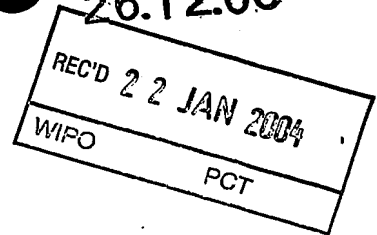


日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2003年 2月 6日
Date of Application:

出願番号 特願2003-029196
Application Number:
[ST. 10/C]: [JP 2003-029196]

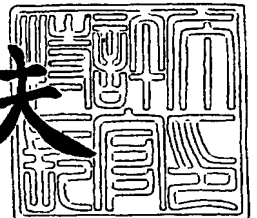
出願人 NOK株式会社
Applicant(s): 株式会社デンソー

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2003年12月16日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



BEST AVAILABLE COPY

【書類名】 特許願

【整理番号】 19182

【提出日】 平成15年 2月 6日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 F16L 17/00

【発明の名称】 密封装置および接続装置

【請求項の数】 8

【発明者】

【住所又は居所】 熊本県阿蘇郡阿蘇町永草堤 2089 エヌオーケー株式会社内

【氏名】 金ヶ江 英和

【発明者】

【住所又は居所】 熊本県阿蘇郡阿蘇町永草堤 2089 エヌオーケー株式会社内

【氏名】 吉井 和紀

【発明者】

【住所又は居所】 熊本県阿蘇郡阿蘇町永草堤 2089 エヌオーケー株式会社内

【氏名】 松澤 邦吉

【特許出願人】

【識別番号】 000004385

【氏名又は名称】 エヌオーケー株式会社

【代理人】

【識別番号】 100094053

【弁理士】

【氏名又は名称】 佐藤 隆久

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2002-382243

【出願日】 平成14年12月27日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 014890

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9005987

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 密封装置および接続装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

互いに連結される第 1 および第 2 の部材を備え、当該第 1 の部材と第 2 の部材との間からの加圧されたガスの漏れを防止する密封装置であって、

前記第 1 および第 2 の部材のうちのいずれかの装着部に装着され、前記第 1 および第 2 の部材の被シール面間をシールするゴム材製のシール部材と、

前記シール部材よりも前記ガスが透過しにくい材料により形成され、前記装着部に装着されて、前記ガスによる前記第 1 および第 2 の部材の内部と外部との間の圧力差を受ける前記シール部材を支持するバックアップリングと

を有し、

前記装着部は、前記バックアップリングの装着位置における前記第 1 および第 2 の部材の被シール面間距離が、前記ガスの非加圧側に向かって漸次減少する部材側テーパ面を有し、

前記バックアップリングは、前記部材側テーパ面の向きに対応する向きのリング側テーパ面を有する

密封装置。

【請求項 2】

前記部材側テーパ面および前記リング側テーパ面は、前記圧力差を受ける前記シール部材によって押圧された前記バックアップリングを、前記被シール面間において圧縮し、当該被シール面に密着させる

請求項 1 に記載の密封装置。

【請求項 3】

前記部材側テーパ面および前記リング側テーパ面の形状は、前記被シール面に密着する方向に前記バックアップリングを部分的に圧縮する形状である

請求項 2 に記載の密封装置。

【請求項 4】

第 1 および第 2 の部材の連結により形成される溝に、前記第 1 および第 2 の部

材の被シール面間をシールするゴム材製のシール部材を収容して、前記被シール面間からの加圧されたガスの漏れを防止する密封装置であって、

前記溝は、

前記第 1 および第 2 の部材の連結により互いに当接する当接面に連続して形成され、

収容した前記シール部材を、前記ガスの圧力により前記被シール面の前記当接面側に押圧させて密着させる形状を有する

密封装置。

【請求項 5】

互いに連結される第 1 の部材と第 2 の部材との間からの加圧されたガスの漏れをシール部材によって防止する密封装置であって、

前記シール部材は、両面に平面状のシール面を有する平板状に形成され、

前記第 1 および第 2 の部材は、当該第 1 および第 2 の部材の連結において互いに対向する平面状の被シール面を有し、

前記第 1 および第 2 の部材の連結により、平面状の前記シール面を前記被シール面間に密着させて、平板状の前記シール部材を前記第 1 および第 2 の部材で挟んでシールする

密封装置。

【請求項 6】

加圧されたガスを流す流路を備え、互いに連結される第 1 および第 2 の接続部材と、

前記ガスが透過する材料により形成され、前記第 1 および第 2 の接続部材の被シール面間をシールするシール部材と、

前記シール部材よりも前記ガスが透過しにくい材料により形成され、前記第 1 および第 2 の接続部材の内部と外部との間の圧力差を受ける前記シール部材を支持する支持面を有するバックアップリングと、

前記圧力差を受ける前記シール部材によって押圧される前記バックアップリングを変形させて、前記第 1 および第 2 の接続部材の被シール面と前記バックアップリングの支持面との間に存在する隙間を狭める隙間狭小化手段と

を有する接続装置。

【請求項 7】

加圧されたガスを流す流路を備え、互いに連結される第 1 および第 2 の接続部材と、

前記ガスが透過する材料により形成され、前記第 1 および第 2 の接続部材の被シール面間をシールするシール部材と、

前記第 1 および第 2 の接続部材の連結により互いに当接する当接面に連続し、収容した前記シール部材を、前記ガスの圧力により前記被シール面の前記当接面側に押圧させて密着させる収容部と

を有する接続装置。

【請求項 8】

加圧されたガスを流す流路を備え、互いに連結される第 1 および第 2 の接続部材と、

前記ガスが通過する開孔部を備える平板状に形成され、両面の平面状のシール面により前記第 1 および第 2 の接続部材の間をシールするシール部材と

を有し、

平板状の前記シール部材は、前記開孔部を前記流路に連通させ、かつ、前記シール面を前記第 1 および第 2 の接続部材の対向する平面状の被シール面に密着させて、前記第 1 および第 2 の接続部材の間に挟まれる

接続装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、連結される部材からの加圧されたガスの漏れを、シール部材によりシールする密封装置および接続装置に関する。

特定的には、本発明は、シール部材からのガスの透過を減少させてシール効果を向上させた密封装置、および、この密封装置を用いた接続装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

自動車や屋内での冷房に用いるエアコンディショナー等の冷房装置においては、配管内を冷媒が流れている。

従来は、冷媒としてはフロンガスを用いていたが、フロンガスがオゾン層を破壊するという環境問題から、冷媒としてCO₂ガス（以下、炭酸ガスと称する）を使用した冷房装置も用いられている。

【0003】

炭酸ガスを冷媒に用いる場合には、フロンガスを用いていた場合よりも高い、たとえば15MPa程度の圧力に加圧された炭酸ガスが配管内部を流れる。

このように、加圧された炭酸ガスを流す配管を接続する場合には、たとえばOリング等のゴム製のシール部材と、ガスの圧力と配管外部との圧力差によるシール部材の配管の間へのはみ出しを防止してシール部材のシール性能を確保するためのバックアップリングとを用いる。

シール部材は、配管の接続部に設けられる一方の接続部材の被シール面と他方の接続部材の被シール面との間をシールするように配置される。バックアップリングは、配管の内部と外部との圧力差によりシール部材が移動する移動方向に、シール部材を支持するように配置する。バックアップリングは、従来はその断面形状が長方形であった。

ガスの圧力が15MPa程度である場合には、断面長方形のバックアップリングによってシール部材のはみ出しを十分に防止することができた。

【0004】

また、特許文献1に示すように、ポリアミド樹脂製であり、断面形状がU字状やY字状のパッキンを用いて、高圧の炭酸ガスを流す配管をシールする手法も知られている。

【0005】

【特許文献1】

特開2001-208201号公報

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

フロンガスの場合には、汎用的なゴム製のシール部材のみを用いることによっ

て接続部材からのフロンガスの漏れを防ぐことができた。しかしながら、炭酸ガスはゴムを透過し易いという性質がある。上述のように炭酸ガスの圧力を高くすると、炭酸ガスはさらに容易にゴムを透過する。したがって、ゴム製のシール部材をバックアップリングによって支持するだけでは、バックアップリングと接続部材との隙間から、ゴム製のシール部材を透過した炭酸ガスが漏れ出し、十分なシール性能を得ることができない。その結果、たとえば冷房装置内の冷媒としての炭酸ガスの量が減少し、装置が故障する可能性が生じる。

ゴム製シール部材とバックアップリングとを複数用いれば炭酸ガスの減少を抑制できる可能性があるが、装置の大型化やコスト上昇等の不利益につながる。

【0007】

また、特殊な材質や断面形状を有する特殊なパッキンを用いる場合には、特殊なパッキンを用意するためのコスト上昇や、汎用性に欠けるという不利益がある。

【0008】

したがって、本発明の目的は、ガスがシール部材を透過し易い状態においても、汎用的なシール部材を用いて、連結される部材の間を簡単かつ効果的にシールすることが可能な密封装置を提供することにある。

また、本発明の他の目的は、配管を流れるガスがシール部材を透過し易い状態においても、汎用的なシール部材を使用して、配管を簡単かつ効果的にシールして接続することが可能な接続装置を提供することにある。

【0009】

【課題を解決するための手段】

本発明の第1の観点に係る密封装置は、互いに連結される第1および第2の部材を備え、当該第1の部材と第2の部材との間からの加圧されたガスの流出を防止する密封装置であって、前記第1および第2の部材のうちのいずれかの装着部に装着され、前記第1および第2の部材の被シール面間をシールするゴム材製のシール部材と、前記シール部材よりも前記ガスが透過しにくい材料により形成され、前記装着部に装着されて、前記ガスによる前記第1および第2の部材の内部と外部との間の圧力差を受ける前記シール部材を支持するバックアップリングと

を有し、前記装着部は、前記バックアップリングの装着位置における前記第 1 および第 2 の部材の被シール面間距離が、前記ガスの非加圧側に向かって漸次減少する部材側テーパ面を有し、前記バックアップリングは、前記部材側テーパ面の向きに対応する向きのリング側テーパ面を有する。

【0010】

本発明の第 2 の観点に係る密封装置は、第 1 および第 2 の部材の連結により形成される溝に、前記第 1 および第 2 の部材の被シール面間をシールするゴム材製のシール部材を収容して、前記被シール面間からの加圧されたガスの流出を防止する密封装置であって、前記溝は、前記第 1 および第 2 の部材の連結により互いに当接する当接面に連続して形成され、収容した前記シール部材を、前記ガスの圧力により前記被シール面の前記当接面側に押圧させて密着させる形状を有する。

【0011】

本発明の第 3 の観点に係る密封装置は、互いに連結される第 1 の部材と第 2 の部材との間からの加圧されたガスの流出をシール部材によって防止する密封装置であって、前記シール部材は、両面に平面状のシール面を有する平板状に形成され、前記第 1 および第 2 の部材は、当該第 1 および第 2 の部材の連結において互いに対向する平面状の被シール面を有し、前記第 1 および第 2 の部材の連結により、平面状の前記シール面を前記被シール面間に密着させて、平板状の前記シール部材を前記第 1 および第 2 の部材で挟んでシールする密封装置である。

【0012】

本発明の第 4 の観点に係る接続装置は、加圧されたガスを流す流路を備え、互いに連結される第 1 および第 2 の接続部材と、前記ガスが透過する材料により形成され、前記第 1 および第 2 の接続部材の被シール面間をシールするシール部材と、前記シール部材よりも前記ガスが透過しにくい材料により形成され、前記第 1 および第 2 の接続部材の内部と外部との間の圧力差を受ける前記シール部材を支持する支持面を有するバックアップリングと、前記圧力差を受ける前記シール部材によって押圧される前記バックアップリングを変形させて、前記第 1 および第 2 の接続部材の被シール面と前記バックアップリングの支持面との間に存在す

る隙間を狭める隙間狭小化手段とを有する。

【0013】

本発明の第5の観点に係る接続装置は、加圧されたガスを流す流路を備え、互いに連結される第1および第2の接続部材と、前記ガスが透過する材料により形成され、前記第1および第2の接続部材の被シール面間をシールするシール部材と、前記第1および第2の接続部材の連結により互いに当接する当接面に連続し、収容した前記シール部材を、前記ガスの圧力により前記被シール面の前記当接面側に押圧させて密着させる収容部とを有する。

【0014】

本発明の第6の観点に係る接続装置は、加圧されたガスを流す流路を備え、互いに連結される第1および第2の接続部材と、前記ガスが通過する開孔部を備える平板状に形成され、両面の平面状のシール面により前記第1および第2の接続部材の間をシールするシール部材とを有し、平板状の前記シール部材は、前記開孔部を前記流路に連通させ、かつ、前記シール面を前記第1および第2の接続部材の対向する平面状の被シール面に密着させて、前記第1および第2の接続部材の間に挟まれる接続装置である。

【0015】

本発明の第1または第4の観点に係る密封装置または接続装置においては、第1および第2の部材または接続部材の内部または外部に、加圧されたガスが存在する。シール部材は、ガスの漏れを防止する位置にある第1および第2の部材または接続部材の被シール面間をシールする。ガスの圧力により、シール部材が、第1および第2の部材または接続部材の内部と外部との間の圧力差を受ける。シール部材が圧力差を受けることにより、支持面でシール部材を支持するバックアップリングがシール部材によって押圧される。シール部材は、ゴム等の、シールするガスが透過する材料によって形成され、バックアップリングはシール部材よりもガスが透過しにくい材料によって形成される。たとえばテーパ面である隙間狭小化手段は、シール部材によって押圧されるバックアップリングを、第1および第2の接続部材の被シール面と支持面との間に存在する隙間を狭める方向に変形させる。

そして隙間がなくなった被シール面と支持面とに、シール部材が隙間なく密着するようになる。

【0016】

本発明の第2または第5の観点に係る密封装置または接続装置においては、シール部材は、第1および第2の部材または接続部材の内部または外部に存在するガスが透過するゴム等の材料によって形成され、第1および第2の部材または接続部材の被シール面間をシールする。

第1および第2の部材または接続部材の連結により、隙間がなくなった当接面が形成される。また、この当接面に連続して、シール部材が収容される溝または収容部が形成される。

ガスの圧力によってシール部材が押圧され、溝または収容部の当接面側に隙間なく密着される。その結果、シール部材のガス透過面積が限りなく小さくなる。

【0017】

本発明の第3または第6の観点に係る密封装置または接続装置においては、第1および第2の接続部材または部材の間をシールするシール部材が、平板状に形成される。

平板状のシール部材を第1および第2の部材または接続部材の対向面間に挟むことによって、平板状のシール部材の両面の平面状のシール面が、第1および第2の部材または接続部材の平面状の被シール面に密着する。

これにより、被シール面は、ガスが透過する面積を小さく、かつ、ガスが透過する距離を長くすることを可能としたシール部材によってシールされる。

【0018】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照しながら述べる。

なお、以下では、本発明の実施の形態の一例として、炭酸ガスが流れる配管を接続する場合を挙げるが、本発明は、配管の接続部の接続以外のガスの密封にも適用可能である。

【0019】

第1実施形態

図 1 が本発明の第 1 実施形態に係る密封装置としての接続装置を示す断面図であり、図 2 がその要部の模式的な部分拡大図である。

図 1 に示す接続装置 1 は、第 1 の配管 3 と、第 2 の配管 5 と、第 1 の接続部材 7 と、第 2 の接続部材 9 と、シール部材 11 と、バックアップリング 13 とを有している。

第 1 の接続部材 7 が本発明における第 1 の部材の一実施態様であり、第 2 の接続部材 9 が本発明における第 2 の部材の一実施態様である。

【0020】

第 1 の配管 3 に第 1 の接続部材 7 が接続され、第 2 の配管 5 に第 2 の接続部材 9 が接続される。配管 3 と接続部材 7 とは、たとえば互いの一方の端部同士を当接させ、当接部の表面 CL1 を溶接することによって接続される。配管 5 と接続部材 9 とは、たとえば互いの一方の端部同士を当接させ、当接部の表面 CL2 を溶接することによって接続される。

接続部材 7 の内部には配管 3 に連通する流路 7a が形成されており、接続部材 9 の内部には配管 5 に連通する流路 9a が形成されている。

配管 3 と配管 5 とを接続する場合には、接続部材 7 と接続部材 9 とは、たとえば図示しないボルトで締結することによって互いに連結される。

【0021】

接続部材 7 と接続部材 9 とが連結されたときに、流路 7a, 9a と配管 3, 5 とを、炭酸ガスが流れる。

ここでは、炭酸ガスは、配管 3 側から配管 5 側に向かって流れるものとする。

また、炭酸ガスは、たとえば 15 MPa 程度に加圧されて流れるものとする。

配管 3, 5 および接続部材 7, 9 は、15 MPa に加圧された炭酸ガスを流した場合にも、炭酸ガスが透過しない材料によって形成する。

【0022】

図 1 に示すように、接続部材 9 において、配管 5 が接続される端部とは反対側の端部には、軸部 19 が設けられている。

また、接続部材 7 における、配管 3 が接続される端部とは反対側の端部には、接続部材 7 と接続部材 9 とを連結する際に軸部 19 を収容するハウジング部 17

が設けられている。

【0023】

軸部 19 は、図 1 および図 2 に示すように、軸部 19 の周方向に設けられた溝 19G と、テーパ面 19T とを有している。

テーパ面 19T は、本発明における隙間狭小化手段の一実施態様に相当する。

テーパ面 19T は、溝 19G の底部から連続して、炭酸ガスが流れる方向に設けられる。炭酸ガスが流れる方向は、接続部 7 と接続部 9 とを連結したときに、接続部 7、9 の外部に連通し、連結された接続部 7 および 9 の内部よりも圧力が低くなる方向である。

テーパ面 19T は、図 1 および図 2 に示すように、溝 19G の底部から圧力が低くなる低圧側に向かうにつれて溝が浅くなるような形状をしている。

【0024】

溝 19G には、シール部材 11 とバックアップリング 13 とが装着される。

シール部材 11 として、以下ではゴム材料製の O リングを一例として挙げて述べる。

O リング 11 は、内周面を溝 19G に接触させて軸部 19 に装着される。

O リング 11 に用いるゴム材料としては、たとえば、フッ素ゴム、パーフロロゴム、水素化ニトリルゴム、ニトリルゴム、ブチルゴム、エチレンプロピレンゴム、エチレンプロピレンジエンゴム、塩素化ポリエチレンゴム、クロロスルホン化ポリエチレンゴム、エピクロルヒドリンゴムを挙げることができる。

【0025】

バックアップリング 13 は、リング状に形成され、溝 19G において、O リング 11 が装着されている位置よりも低圧側となる位置に装着される。

バックアップリング 13 は、溝 19 への装着を容易にするために輪を切断した C 字形状であってもよいし、輪がつながっている完全なリング状であってもよい。完全なリング状のバックアップリングを用いる場合には、軸部 19 に彫り込まれた溝 19G が存在せず、軸部 19 の先端からバックアップリングをテーパ面 19T まで挿入可能な、エンドレスタイプの溝構造を有する接続部材 9 を用いる。

また、バックアップリング 13 における高圧側には、支持面 13S が設けられ

ている。

本実施形態においては、バックアップリング 13 の軸部 19 に接触する内周側には、テーパ面 19T に対応する方向のテーパ面が設けられている。

【0026】

バックアップリング 13 は、たとえば、ポリアクリロニトリル樹脂、ポリビニルアルコール樹脂、ポリアミド樹脂、ポリビニルフロライド樹脂、高密度ポリエチレン樹脂、ポリスチレン樹脂、PEEK樹脂、PPS樹脂、LCP樹脂、ポリイミド樹脂等の樹脂材料によって形成される。

これらの樹脂材料は、炭酸ガスがほとんど透過しない性質を有している。

バックアップリング 13 は、46 ナイロン等の気体を通しにくい合成高分子材料によって形成することも可能である。

【0027】

配管 3 と配管 5 とを接続する場合には、溝 19G に O リング 11 およびバックアップリング 13 を装着し、軸部 19 をハウジング部 17 に挿入させて、接続部材 7 と接続部材 9 とを連結する。

接続部材 7 と接続部材 9 とが連結された場合に、O リング 11 は、ハウジング部 17 の内周面の被シール面 S1 と、軸部 19 の溝 19G の底部の被シール面 S2 とに接触して、被シール面 S1 と被シール面 S2 との間をシールする。

【0028】

連結された接続部材 7 と接続部材 9 とに、接続部材 7 側から接続部材 9 側に向かって、加圧された炭酸ガスを流すと、O リング 11 は、接続部材 7 および接続部材 9 の内部と外部との間の圧力差を受ける。

圧力差を受けた O リング 11 は、図 2 に示す低圧側 LS に押圧される。低圧側 LS は、接続装置 1 に加圧されて送り込まれる炭酸ガスの非加圧側に相当する。

O リング 11 はバックアップリング 13 の支持面 13S によって支持されている。このため、圧力差を受けて押圧された O リング 11 によって、さらにバックアップリング 13 が低圧側 LS に押圧される。

低圧側 LS に押圧されたバックアップリング 13 は、樹脂製または高分子材料性であるため、テーパ面 19T によって拡張して、内周のテーパ面と外周面とが、

テーパ面 19T と被シール面 S1 とにそれぞれ嵌合して密着するように弾性変形する。

これにより、被シール面 S1 および S2 とバックアップリング 13 の支持面 13S との間に存在する隙間 20S が狭まる。

【0029】

一方、従来のように、テーパ面 19T が存在しない場合には、バックアップリング 13 によって、ハウジング部 17 と軸部 19 との間の隙間 20 への Oリング 11 のはみ出しを防止することは可能であるものの、圧力差を利用して隙間 20S を狭めることはできない。

【0030】

押圧された Oリング 11 は、隙間 20S が狭まった被シール面 S1, S2 と支持面 13S とにはほぼ全面的に密着するようになる。これにより、図 2 に示すように、Oリング 11 を透過する炭酸ガス G の低圧側 LS における透過面積は限りなく小さくなる。したがって、低圧側 LS への炭酸ガス G の漏れ量を限りなく小さくすることができる。

ガス透過面積を小さくすることによってガス漏れ量を減少させることが可能であるという原理については後述する。

【0031】

以上のように、本第 1 実施形態に係る接続装置 1 においては、炭酸ガスを透過する材料からなる Oリング 11 を用いた場合にも、接続部材 7, 9 の外部への炭酸ガスの漏れ量を可能なかぎり小さくすることができる。

その際に、複雑な構造や手順を必要としないため、簡単かつ容易に炭酸ガスの漏れ量を小さくすることができる。

また、接続装置の構造が簡単であり、汎用性のある Oリングを用いることができるため、コストの上昇を抑制することもできる。

【0032】

確認実験

以下では、隙間 20S とガス漏れ量との相関関係を調べるための確認実験について述べる。

【0033】

確認実験の前に、まず、シール部材のガス透過面積とガス漏れ量との間の関係について述べる。

ここで、ガス透過面積とは、シール部材の表面積のうちで、シール部材の内部を透過するガスがシール部材の外部へ出ていくことが可能な面積のことである。

ガスの種類、圧力 P 、温度 T 、ならびにシール部材のガス透過係数 P_0 およびガスが透過する部分の形状が定まれば、ガス漏れ量は、下記式(1)によって見積もることができる。

【0034】

【数1】

ガス漏れ量(g)

$$= \frac{\text{ガスの分子量}(g/mol)}{22410(cm^3(STP)/mol)} \times \frac{P_0(P,T=const) \times \text{透過時間}(sec) \times \text{透過面積}(cm^2) \times P(Pa)}{\text{透過距離}(cm)}$$

... (1)

【0035】

ここで、式(1)におけるSTPは、標準状態(温度 0° 、1 atm)を表わしている。

また、ガス透過係数 P_0 は、下記式(2)によって単位化した、シール部材のガス透過特性を示す係数である。

【0036】

【数2】

$$\text{ガス透過係数 } P_0 = \frac{\text{ガス透過量}(cm^3(STP))}{\text{透過時間}(sec)} \times \frac{\text{透過距離}(cm)}{\text{透過面積}(cm^2) \times \text{ガス圧力}(Pa)}$$

... (2)

【0037】

上記式(1)から、シール部材の透過面積が小さいほどガス漏れ量も小さくなることが分かる。

ここで、JIS K7126のプラスチックフィルム及びシートの気体透過度試験方法のA法（差圧法）に基づいて、ゴム材料からなるシート状のシール部材の炭酸ガス透過特性を調べた。このとき、ガス漏れ量を直接求めるのではなく、シート状のシール部材のガス透過量を調べた。式（1）および式（2）から、ガス透過量が多い場合にはガス透過係数 P_0 が大きくなり、結果的にガス漏れ量も増えることが分かる。

以下に詳細を記す。

【0038】

図3（a）～（c）が、炭酸ガスの透過量の測定に用いた気体透過度測定装置の要部の模式的な構成図である。

気体透過度測定装置および測定方法についてはJIS K7126に記載されているためここでは簡単な記載に留めるが、気体透過度測定装置は、図3（a）に示すように、上部セル31と下部セル32とから構成される透過セル30を有している。

上部セル31および下部セル32は、接続部の内周面が、内径R1の円形形状をしている。内径R1の大きさは、ここでは70mmとした。

また、上部セル31は、図示しない試験気体供給器に接続され、試験気体としての炭酸ガスGが導入される導入口31aを有している。下部セル32は、図示しない圧力検出器に接続され、試験片35を透過した炭酸ガスGが導出される導出口32aを有している。

【0039】

試験片35は、図3に示すように、上部セル31と下部セル32との間に、上部セル31と下部セル32との間を密封するように装着される。

試験片35としては、ブチルゴムのシートを用いた。ブチルゴムシート35の厚さは、0.3mmとした。

【0040】

なお、図3（b）は、図3（a）に示す構成に加えて、直径R2の開孔が中央部に形成されたアルミニウム板37を、ブチルゴムシート35の上部セル31側の面に配置し、アルミニウム板37およびブチルゴムシート35の両方を上部セル

31と下部セル32とにより挟み込んだ場合を示している。

また、図3(c)は、アルミニウム板37をブチルゴムシート35の下部セル32側の面に配置し、アルミニウム板37およびブチルゴムシート35の両方を上部セル31と下部セル32とにより挟み込んだ場合を示している。

なお、アルミニウム板37の開孔の直径R2は、図3(b), (c)の場合とも10mmとした。

【0041】

以上の状態において、透過セル30を真空吸引してから、70℃の炭酸ガスGを約101325Pa(1気圧)で上部セル31に導入し、下部セル32における炭酸ガスGの透過量を測定した。

その結果は、図3(a)の場合には、透過量が、ブチルゴムシート35の厚さ1mm当たりで $2.3 \text{ cm}^3 \cdot \text{mm} / 24 \text{ h} \cdot 101325 \text{ Pa}$ となった。

また、図3(b)の場合には透過量は $2.3 \text{ cm}^3 \cdot \text{mm} / 24 \text{ h} \cdot 101325 \text{ Pa}$ であり、図3(c)の場合には $0.23 \text{ cm}^3 \cdot \text{mm} / 24 \text{ h} \cdot 101325 \text{ Pa}$ であった。

【0042】

図3(b)に図解のように高圧の上部セル31にアルミニウム板37を設けても、ガス透過量はアルミニウム板37が無い図3(a)の場合と同じである。一方、図3(c)に図解のように低圧の下部セル32側にアルミニウム板37を設けることによって、ガス透過量は図3(a)の場合の1/10になる。

以上により、ガス透過量を減少させるためには、ゴム製シール部材にガスが入るガス侵入面積を狭くすることは有効ではなく、シール部材の内部を透過したガスが出るためのガスの出口を狭くすることが有効であることが分かり、ガス透過面積を狭くしたと言える。

したがって、図1に示す接続装置1において、隙間20Sを小さくすることにより、Oリング11の透過面積を可能な限り小さくすることができ、隙間20Sを小さくすることが接続部材7, 9の外部への炭酸ガスの漏れを防ぐために有効であることが分かる。

【0043】

バックアップリングおよび被シール面

ところで、隙間 20S を可能な限り小さくするためには、被シール面 S1, S2 の間にバックアップリング 13 を適切に装着する必要がある。

以下に、軸部 19 のテーパ面 19T およびバックアップリング 13 のテーパ面 13T と、隙間 20S との関係を、図 11 を参照して詳細に述べる。

【0044】

図 11 (a), (b) は、図 2 と同様に接続装置 1 の要部を示した部分拡大図である。このため、図 2 に示す構成要素と同一の構成要素には同一符号を付し、詳細な記述は省略する。ただし、図 11 (a), (b) において O リング 11 は図示を省略している。

【0045】

図 11 (a) は、常温で炭酸ガスを流さずバックアップリング 13 を押圧しない状態における溝 19G へのバックアップリング 13 の装着状態を示している。

たとえば、図 11 (a) に示すように、バックアップリング 13 の外径がハウジング部 17 の内径よりも小さくなるようにバックアップリング 13 を形成する。また、前述のように、バックアップリング 13 の内周側には、軸部 19 のテーパ面 19T の向きに対応した向きであり、テーパ面 19T の傾きと同じ傾きを有するリング側テーパ面 13T を形成しておく。

【0046】

テーパ面 19T と同じ傾きのテーパ面 13T を有するバックアップリング 13 を、溝 19G に装着する。炭酸ガスを流さずバックアップリング 13 を押圧しない状態においては、被シール面 S1 および S2 とバックアップリング 13 の支持面 13S との間に隙間 20S が存在する。この隙間 20S の大きさは、たとえば、0.05mm であったとする。

【0047】

炭酸ガスが流れると、接続装置 1 の内部の高圧側 HS から、外部に連通する低圧側 LS に向かって、図示しない O リングを介してバックアップリング 13 が押圧される。その結果、図 11 (b) に示すように、バックアップリング 13 が低圧側 LS に移動する。

このとき、テーパ面 19T の作用により、低圧側 LS への移動に伴ってバックアップリング 13 は拡張し、隙間 20S が狭まる。

しかしながら、テーパ面 19T とテーパ面 13T の傾きが同じであり、かつ、炭酸ガスを流さない状態において隙間 20S が存在している場合には、炭酸ガスからの押圧力は主としてバックアップリング 13 を拡張させるための応力に変換される。このため隙間 20S は狭まるものの、低圧側 LS への移動に伴い被シール面 S1, S2 に密着させるほどバックアップリング 13 を圧縮する応力はほとんど発生しない。

【0048】

被シール面 S1, S2 間におけるテーパ面 19T とバックアップリング 13 のテーパ面 13T との関係を図 11 に示す構成にし、たとえば 46 ナイロンによってバックアップリング 13 を形成する。また、たとえば、常温において 6.5 MPa の炭酸ガスを高圧側 HS に流す。

このとき、図 11 (b) に示すように被シール面 S1, S2 とバックアップリング 13 の支持面 13S との距離が狭まった状態における隙間 20S の大きさは、 $0.99 \times 10^{-3} \text{mm}$ であった。この程度の大きさの隙間 20S が存在すると、炭酸ガスの漏れが生じる。

このように、溝 19G とバックアップリング 13 とに単にテーパ面 19T とテーパ面 13T とを設けただけでは、隙間 20S を可能な限りゼロに近づけることはできない。

【0049】

隙間 20S を可能な限り小さくするためには、たとえば、図 4 に示す構成のバックアップリングおよび被シール面 S1, S2 にする。

図 4 (a), (b) は図 11 (a), (b) と同じく接続装置 1 の要部を示した部分拡大図であり、(a) が炭酸ガスを流さない状態を示しており、(b) が炭酸ガスによりバックアップリングを押圧した状態を示している。ただし、図 4 において Oリング 11 は図示を省略している。

【0050】

図 4 に示すバックアップリング 13e は、テーパ面の傾きが図 11 に示すバック

クアップリング 13 のテーパ面 13T とは異なっている。図 4 に示すバックアップリング 13e 以外の構成要素は図 2 および図 11 に示す構成要素と同じであるため、同一構成要素には同一符号を付し、詳細な記述は省略する。

【0051】

図 4 (a) に示すように、バックアップリング 13e の内周側には、高圧側 HS の内径 Rd1 よりも低圧側 LS の内径 Rd2 が大きいテーパ面 13Te を形成する。このとき、テーパ面 13Te の傾きは、被シール面 S2 のテーパ面 19T の傾きよりも大きくしておく。

このようなバックアップリング 13e を溝 19G に装着すると、バックアップリング 13e の内周側には、高圧側 HS から低圧側 LS に向かってひろがる隙間が発生する。したがって、バックアップリング 13e のテーパ面 13Te が形成されているテーパ部 13D が、バックアップリング 13e の低圧側 LS への移動に伴ってつぶれるつぶし代になる。

【0052】

炭酸ガスが流れると、図 4 (b) に示すようにバックアップリング 13e は高圧側 HS から低圧側 LS に向かってが押圧され、低圧側 LS に移動する。

テーパ面 13Te とテーパ面 19T との傾きの違いにより、テーパ面 13Te はテーパ面 19T に高圧側 HS において部分的に接触している。したがって、低圧側 LS への移動によって、たとえば、図 4 (b) の領域 13A1, 13A2 で示すバックアップリング 13e の高圧側に、部分的に圧縮応力が加わる。

テーパ面 13Te およびテーパ面 19T の傾きの違いにより部分的に圧縮応力が発生するため、同じ押圧力が印加されたときでも、バックアップリング 13e は図 11 に示すバックアップリング 13 よりも被シール面 S1, S2 に密着する。

これにより、隙間 20S を可能な限り小さくすることができる。

【0053】

たとえば、46 ナイロンによって図 4 (a) に示すように高圧側 HS につぶし代 13D を設けてバックアップリング 13e を形成し、図 11 におけるバックアップリング 13 の試験と同様に、常温において 6.5 MPa の炭酸ガスを高圧側 HS に流した。その結果、高圧側 HS における隙間 20S は計測できないほど小さくなり、

低圧側LSへの炭酸ガスの漏れを可能な限り小さくすることができた。

【0054】

以上のように、テーパ面13Teとテーパ面19Tの傾きを異ならせることによって、バックアップリング13eは低圧側LSへの移動に伴って部分的に圧縮される。被シール面S1と被シール面S2との間で圧縮されることにより、バックアップリング13eの圧縮された部分が被シール面S1, S2に密着する。

【0055】

図4に示すように高圧側HSにつぶし代13Dを設けた場合には、高圧側HSの隙間20Sがゼロに近づくため、炭酸ガスにより押圧されるOリング11が隙間20Sに入り込むおそれがなく、Oリング11の破損を防止することができる。

図4においてはバックアップリング13eの内径側につぶし代13Dを設けた例を示したが、外径側につぶし代を設けることも可能である。つぶし代はバックアップリングの内径側か外径側の少なくともいずれか一方に設ければガス漏れを抑制することは可能であるが、両方に設ければガス漏れ量をさらに抑制することができる。

また、図4においては、高圧側HSにおいてバックアップリング13eに部分的な圧縮が発生するようにテーパ面13Teおよびテーパ面19Tの傾きを決めた。しかしながら、ハウジング部17、溝19G、およびバックアップリング13eの形状を工夫することによって、軸部19の軸方向DALに沿ってバックアップリング13eを均一に圧縮させることができる。被シール面S1, S2間においてバックアップリング13eを均一に圧縮することにより、低圧側LSへのガス漏れ量をさらに小さくすることができる。

【0056】

第1実施形態の変形形態

図1に図解の第1実施形態に係る接続装置1は円筒面シールの構造を有していたが、Oリングとバックアップリングとを用いて、他のシール構造を構成することもできる。

【0057】

図5が、Oリングとバックアップリングとを用いて、円筒面シールではなく端

面シール構造を構成した、本発明の第1実施形態の変形形態に係る接続装置50を示す断面図である。

図5に図解の接続装置50は、第1の接続部材7のかわりに接続部材47を用い、第2の接続部材9のかわりに接続部材49を用いている。互いに連結され、内部の流路に加圧された炭酸ガスを流して配管3と配管5とを接続するという接続部材47、49の機能は、第1実施形態の場合と同じである。

また、バックアップリング13のかわりにバックアップリング53を用いている。

Oリングには、接続装置1の場合と同じOリング11を用いるものとする。流すガスの種類や接続部材のシール部の形状に応じて、Oリング11とは異なるOリングを使用することもできる。

【0058】

接続部材47と接続部材49とは、第1実施形態の場合と同様に、たとえば溶接によって配管3と配管5とにそれぞれ接続される。

また、接続部材47にはハウジング部17のかわりにフランジ部57が設けられ、接続部材49には軸部19のかわりにフランジ部59が設けられる。フランジ部57とフランジ部59とは、接続部材47と接続部材49とを連結したときに対向するように設けられる。

【0059】

図5に図解のように、接続部材47のフランジ部57に、溝57Gおよびテーパ面57Tが形成される。

テーパ面57Tは、第1実施形態の場合と同様に、溝57Gの底部から連続して、接続部材47および接続部材49の外部の低圧側LSに向かうにつれて溝が浅くなるように形成される。

【0060】

溝57GにOリング11が装着される。Oリング11は、接続装置50においては、接続部材47と接続部材49とを連結したときに、溝57Gの底面とフランジ部59の溝57Gの底面に対向する面とを被シール面として、被シール面間をシールする。

【0061】

バックアップリング53は、本変形形態においては、フランジ部57の溝57Gへの装着が容易であるため、好適には、輪がつながっている完全なリング状に形成する。バックアップリング53は、溝57Gにおいて、内周面である支持面によってOリング11の外周を支持するように配置される。したがって、バックアップリング53は、図5のように断面で見ると、Oリング11よりも低圧側に配置される。

また、バックアップリング53は、第1実施形態において用いたバックアップリング13の材料として挙げた材料と同じ炭酸ガスを透過しにくい樹脂や高分子材料を用いて形成され、テーパ面57Tに嵌合するテーパ面を有している。

【0062】

以上の構成により、端面シール構造を実現することができる。

接続部材47、49を連結し、配管3、5に加圧されたガスを流した場合には、第1実施形態の場合と同様に、接続部材47、49の内部の高圧側HSと外部の低圧側LSとの間の圧力差を受けてOリング11が低圧側LSに押圧される。

支持面を介してOリング11によって押圧されたバックアップリング53は、低圧側LSに移動し、テーパ面57Tによって、溝57Gおよびフランジ部59の被シール面と支持面との間の隙間が狭まるように弾性変形される。

これにより、第1実施形態の場合と同様に、低圧側LSにおけるOリング11のガス透過面積が限りなく小さくなり、低圧側LSへの炭酸ガスの漏れを限りなく小さくすることができる。

【0063】

以上のように、端面シール構造にした場合にも、低圧側LSへの炭酸ガスの漏れを従来よりも大幅に抑制することができる。

また、第1実施形態の場合と同様の効果を得ることができる。

さらに、端面シール構造にした場合には、第1実施形態の場合と比較して接続部材の形状を単純なものにすることができ、コスト低下につながられるという効果も得ることができる。

【0064】

第2実施形態

図6が、本発明の第2実施形態に係る接続装置および密封装置を示す断面図であり、図7がその要部の模式的な部分拡大図である。

第2実施形態に係る接続装置100は、第1実施形態ならびにその変形形態のようなバックアップリングを用いずに炭酸ガスの漏れを防ぐための接続装置である。

接続装置100は、バックアップリングを有しておらず、第1および第2の接続部材としての接続部材107および接続部材109の形状が、第1実施形態とは異なっている。

それ以外の構成はこれまでの実施形態と同じであるため、詳細な記述は省略する。

【0065】

接続部材109の軸部119は、Oリング11が装着される溝を有していない。その代わりに、接続部材107および接続部材109には、互いを連結させたときに当接する当接面が設けられている。

たとえば、図6に図解の場合には、接続部材107の当接面AS1は、ハウジング部117の先端の接続部材109に対向する面として設けられている。また、接続部材109の当接面AS2は、軸部119が設けられるベースとしての面になっている。

【0066】

本実施形態においては、たとえば、接続部材107、109を連結したときに、当接面AS1、AS2に連続した溝120が形成されるようにハウジング部117の先端面が面取りされている。

溝120が、本発明における収容部の一実施態様に相当する。

ハウジング部117の先端面は、たとえば、溝120の断面形状が、図7に示すように当接面AS1、AS2に向かうにつれて狭くなる三角形状になるように面取りされる。

ハウジング部117の面取り面が、接続部材107の被シール面S10となる。また、断面三角形状の溝120の被シール面S10以外の2面が、接続部材1

19の被シール面S20になる。

溝120は、接続部材107と接続部材109とが連結されたときに、Oリング11を収容する。

Oリング11は、接続部材107の被シール面S10と接続部材109の被シール面S20との間をシールする。

【0067】

以上の構成により、接続部材107、109を連結した場合に、図7に示すように、当接面AS1と当接面AS2とが互いに当接することによって、Oリング11の低圧側LSにおける隙間20ASがゼロに近づく。

また、溝120が被シール面S10および被シール面S20によってOリング11を押圧して、更に、ガスの圧力がOリング11に作用することにより、当接面AS1、AS2と被シール面S10、S20との間の隙間を埋めるようにOリング11が弾性変形する。

これにより、低圧側LSにおけるOリングのガス透過面積が限りなく小さくなり、炭酸ガスの漏れ量が減少する。

【0068】

以上のように、本第2実施形態によっても、低圧側LSへの炭酸ガスの漏れ量を可能な限り小さくすることができる。

その際に、バックアップリングを必要としないため、これまでの実施形態よりもさらに簡単かつ容易に炭酸ガスの漏れを防ぐことができる。また、これまでの実施形態よりもさらに接続装置のコストが低下する。

【0069】

第3実施形態

図8が、本発明の第3実施形態に係る接続装置および密封装置を示す断面図である。

本第3実施形態に係る接続装置150は、Oリングではなく平板状のシール部材を用いてシールする接続装置である。

図8に示すように、接続装置150は、第1の接続部材157と、第1実施形態の変形形態において用いた接続部材と同じ第2の接続部材49と、シール部材

151とを有している。

これら以外の構成要素はこれまでの実施形態のものと同一であるため、詳細な記述は省略する。

【0070】

第1の配管3に接続される接続部材157は、第2の配管5に接続される接続部材49と同じである。

接続部材157および接続部材49は、互いに連結されたときに対向する被シール面S30および被シール面S40をそれぞれ有している。図8に図解のように、被シール面S30、S40は、平面状である。

接続部材157および接続部材49は、第1実施形態における接続部材7、9と同様に、炭素ガスを透過しにくい材料によって形成される。

【0071】

シール部材151は、たとえば、図8に示すように炭酸ガスを流すための開孔部151aを有する薄い平板状に形成された樹脂シートや、両面にゴムを薄くコーティングした金属製ガスケットである。

平板状のシール部材151の両側の平面がシール面となる。

樹脂の材料としては、たとえば、これまでの実施形態におけるバックアップリングの材料と同じポリアクリロニトリル樹脂、ポリビニルアルコール樹脂、ポリアミド樹脂、ポリビニルフロライド樹脂、高密度ポリエチレン樹脂、ポリスチレン樹脂、PEEK樹脂、PPS樹脂、LCP樹脂、ポリイミド樹脂を用いる。46ナイロン等の気体を通しにくい合成高分子材料によってシール部材151を形成してもよい。

平板状のシール部材151は、配管3、5の接続時に、流路7a、9aに開孔部151aを連通させて、接続部材157と接続部材49との間に挟まれる。

接続部材157と接続部材49との間に平板状のシール部材151を挟むことによって、シール部材151の平面状のシール面が平面状の被シール面S30および被シール面S40に密着し、接続部材157と接続部材49との間がシールされる。

【0072】

接続部材 157, 49 で平板状のシール部材 151 を挟んでシールすることにより、接続部材 157, 49 の外部の低圧側 LS におけるシール部材 151 のガス透過面積が小さくなる。また、炭酸ガスがシール部材 151 の内部を透過して接続部材 157, 49 の内部の高圧側 HS から外部の低圧側 LS に至るまでのガス透過距離が長くなる。

ガス透過面積が小さくなり、透過距離が長くなれば、式 (1) から、ガス漏れ量が減少することが分かる。

【0073】

従来のような O リングを用いた円筒面シールの場合、はめあいの径を小さくすることにより O リング径が小さくなり、これによりガス透過面積を小さくすることができるが、はめあいの径をある程度以下に小さくすることは困難である。また、O リングの線径（断面の径）を小さくすることによっても透過面積を小さくすることができるが、線径を小さくし過ぎると、O リングの最低限のつぶし代を確保することが困難になる。したがって、O リング線径をある程度以下にすることもできない。O リング線径を小さくした場合には、ガス透過距離が短くなることにもつながるため、ガス漏れ量の増加につながるという不利益もある。

【0074】

本実施形態においては、シール部材 151 を平板状にすることにより、上記のような不利益を解消し、低圧側 LS への炭酸ガスの漏れを大幅に低減させることができる。

その際に、接続装置およびシール部材の構造が簡単であり、シール部材には O リングと同じ材料を用いることができるため、容易にシールを行なうことが可能であるとともに汎用性を得ることができ、コスト低減化の効果も得られる。

【0075】

変形形態

以上の実施形態を組み合わせることによって、さらに高いシール効果を得ることができる。その例を図 9 および図 10 に示す。

図 9 に示す接続装置 200 は、本発明の第 1 実施形態と第 2 実施形態とを組み合わせたものである。接続装置 200 においては、O リング 11 と O リング 110

の2つのOリングを用いている。

図10に示す接続装置250は、本発明の第1実施形態と第3実施形態とを組み合わせたものである。ただし、図8におけるシール部材151のかわりに、図10に示すように、接続部材9の軸部19にはめ合う平板状のシール部材251を用いている。

【0076】

以上のように、本発明の実施形態を組み合わせることによって、それ以外には特別な装置や構造を必要とすることなく、さらに高いシール効果を得ることができる。

また、比較的簡単な構造によってシール効果を向上可能であることによって、冷房装置等の装置の高効率化と、その際のコスト抑制を達成できるという効果もある。

【0077】

以上、本発明の実施の形態について述べたが、本発明は上記実施の形態に限定されない。

たとえば、上記実施の形態においては配管の接続部に本発明を適用する形態について述べたが、ガスが封入される容器とその蓋のように、ガスが接触する他の部材間のシールに本発明を適用することも可能である。

また、たとえば第2実施形態において、溝120の断面三角形状の断面形状に合わせて、Oリング351の断面形状を三角形状にしてもよい。

溝120の形状も、断面三角形状に限らず、シール部材の低圧側におけるガス透過面積が小さくなる形状であればよい。溝の形状を変更可能であることは、図9に示す接続装置200の場合にも当てはまる。

第1実施形態およびその変形形態において、図4に示すようなつぶし代13Dを有するバックアップリング13eを用いれば、接続装置200および接続装置250のような他のシール部材を併用する形態よりも高いシール性を得ることが可能になる。これにより、溝120の形成やシール部材251の装着の手間を省き、密封装置および接続装置の構造の複雑化を防止することができる。

また、隙間狭小化手段の形状はテーパ面に限らず、設けられる位置も軸部19

に限らない。たとえば、テーパ面はハウジング部 17 に設けてもよく、被シール面とバックアップリングとの間の隙間を狭小化可能であれば、狭小化手段の形状や配置位置は任意である。

さらには、上記実施形態を、3 つ以上組み合わせて用いてもよい。

本発明に係る接続装置は、冷房装置における炭酸ガスの配管の接続に用いるだけでなく、シール部材およびバックアップリングの材料を適宜選択することにより、他のガスのシールに用いることもできる。

【0078】

【発明の効果】

以上のように、本発明によれば、ガスがシール部材を透過し易い状態においても、汎用的なシール部材を用いて、連結される部材の間を簡単かつ効果的にシールすることが可能な密封装置を提供することができる。

また、本発明によれば、配管を流れるガスがシール部材を透過し易い状態においても、汎用的なシール部材を使用して、配管を簡単かつ効果的にシールして接続することが可能な接続装置を提供することもできる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

図 1 は本発明の第 1 実施形態に係る接続装置および密封装置を示す断面図である。

【図 2】

図 2 は図 1 の要部の模式的な部分拡大図である。

【図 3】

図 3 (a) ～ (c) は炭酸ガスの透過量の測定に用いた気体透過度測定装置の要部の模式的な構成図である。

【図 4】

図 4 (a) , (b) はガス圧力により圧縮される形状のバックアップリングの一例を示す図であり、図 4 (a) は圧縮前の状態を示し、図 4 (b) は圧縮後の状態を示している。

【図 5】

図5は本発明の第1実施形態の変形形態に係る接続装置および密封装置を示す断面図である。

【図6】

図6は本発明の第2実施形態に係る接続装置および密封装置を示す断面図である。

【図7】

図7は図6の要部の模式的な部分拡大図である。

【図8】

図8は本発明の第3実施形態に係る接続装置および密封装置を示す断面図である。

【図9】

図9は本発明の変形形態に係る接続装置および密封装置を示す断面図である。

【図10】

図10は本発明の別の変形形態に係る接続装置および密封装置を示す断面図である。

【図11】

図11 (a), (b) は図1におけるバックアップリングと隙間との関係を説明する図であり、図11 (a) はバックアップリングの押圧前の状態を示し、図11 (b) は圧縮後の状態を示している。

【符号の説明】

1, 50, 100, 150, 200, 250…接続装置

3, 5…配管

7, 9, 47, 49, 107, 109, 157…接続部材 (部材)

7a, 9a…流路

11, 51, 110, 351…シール部材 (Oリング)

13, 13e, 53…バックアップリング

13S…支持面

13Te…リング側テーパ面

17, 117…ハウジング部

1 9 …軸部

1 9 G, 5 7 G …溝

1 9 T, 5 7 T …テーパ面

2 0, 2 0 S …隙間

3 0 …透過セル

3 1 …上部セル

3 2 …下部セル

3 5 …試験片

5 7, 5 9 …フランジ部

1 2 0 …溝 (収容部)

1 5 1, 2 5 1 …平板状シール部材

S 1, S 2, S 1 0, S 2 0 …被シール面

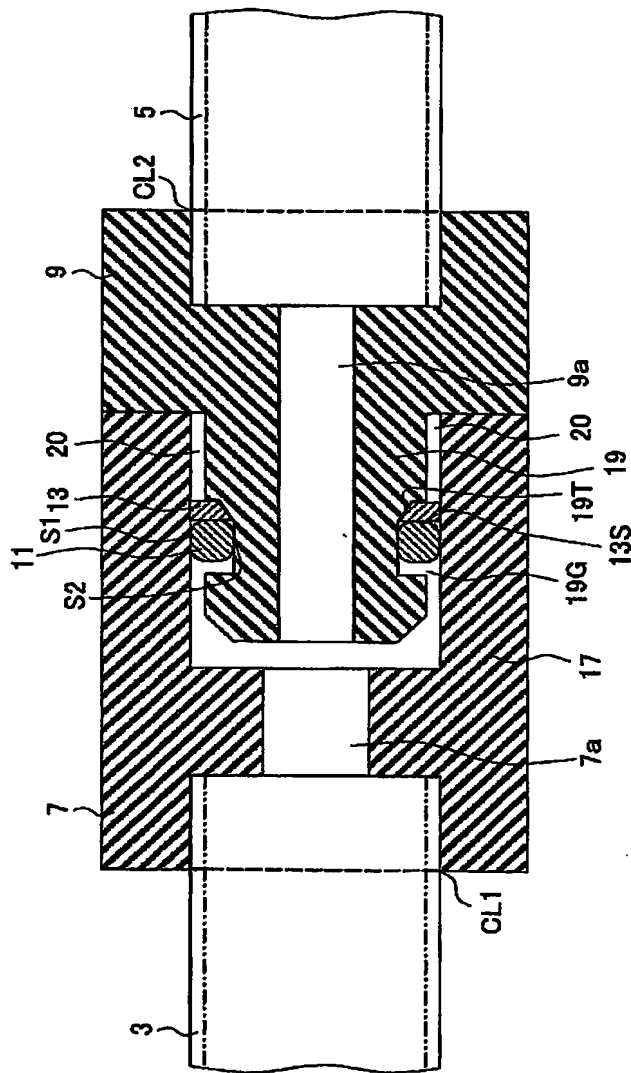
AS 1, AS 2 …当接面

G …炭酸ガス

【書類名】

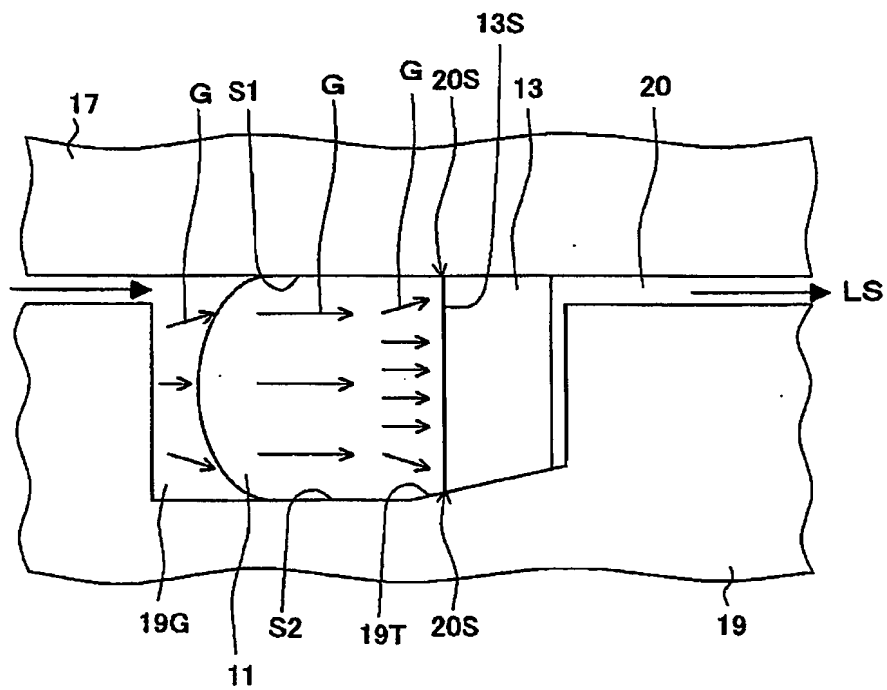
図面

【図 1】

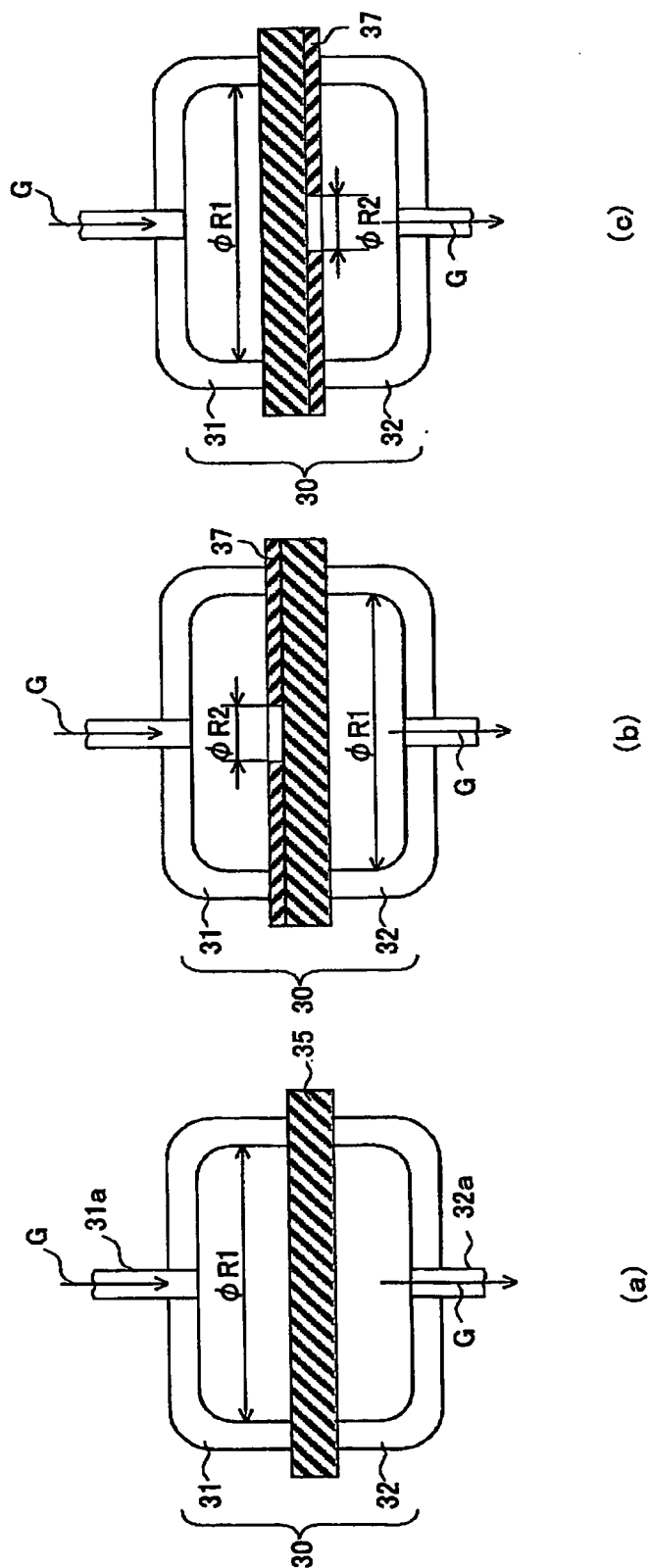


1

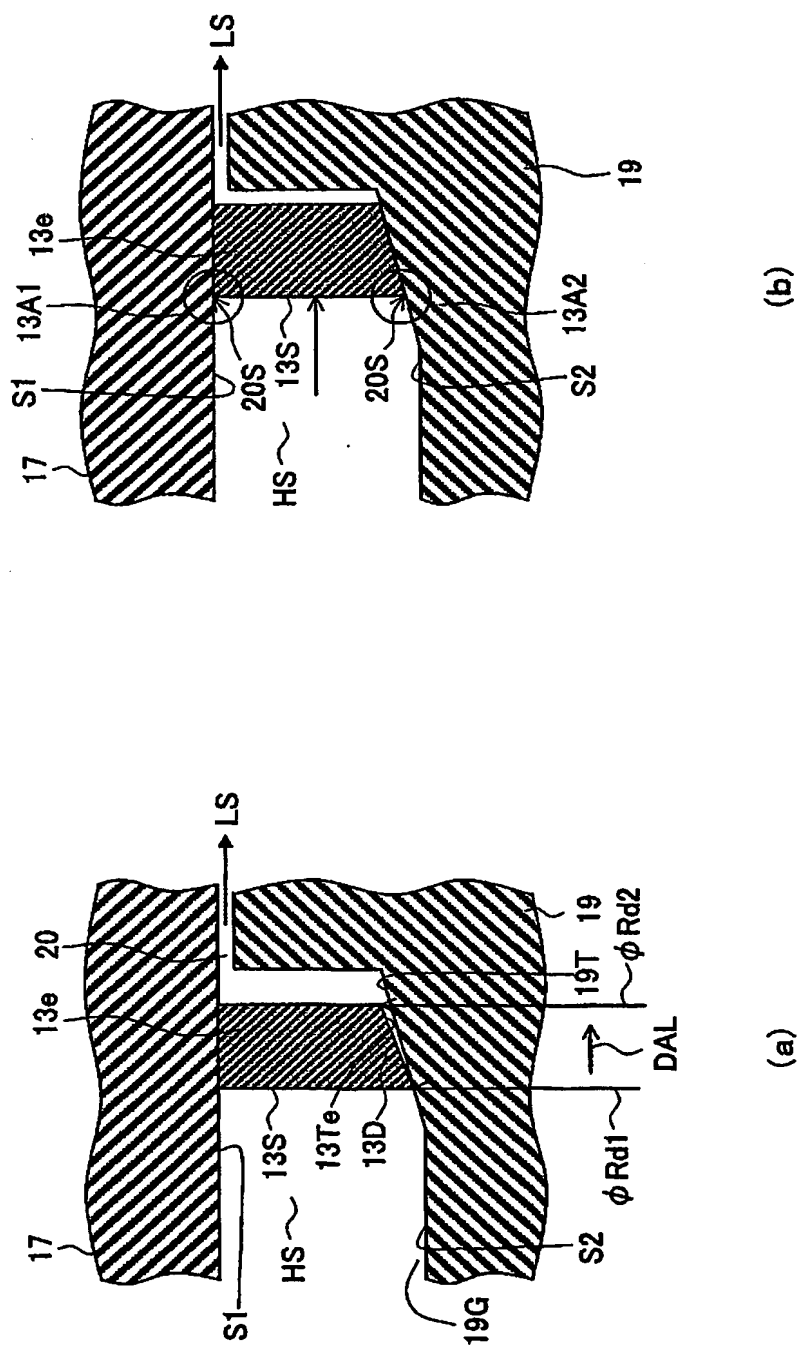
【図 2】



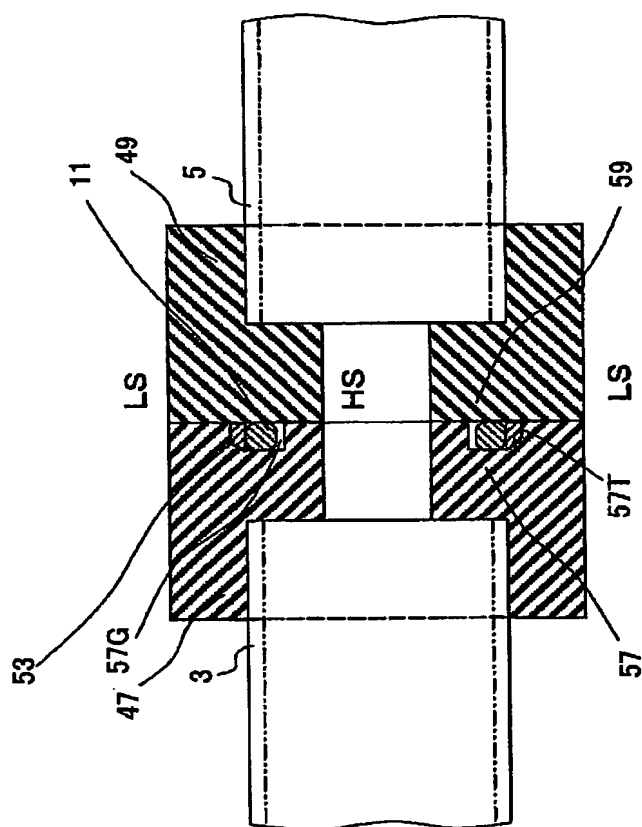
【図3】



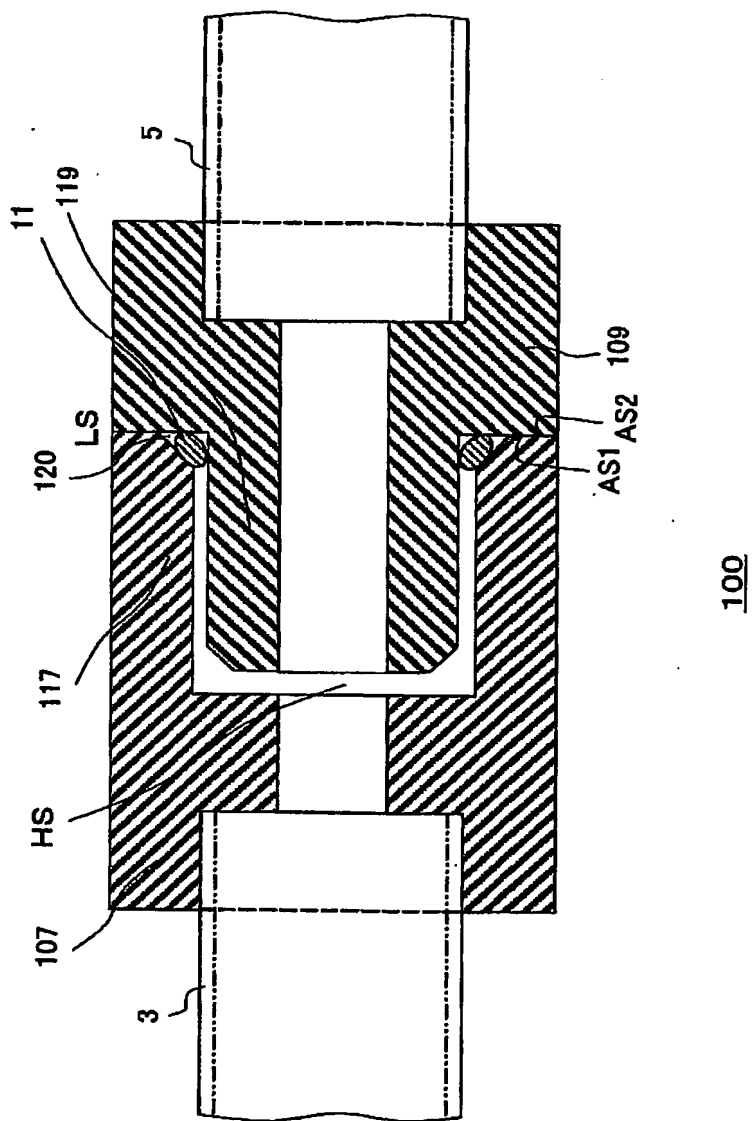
【図 4】



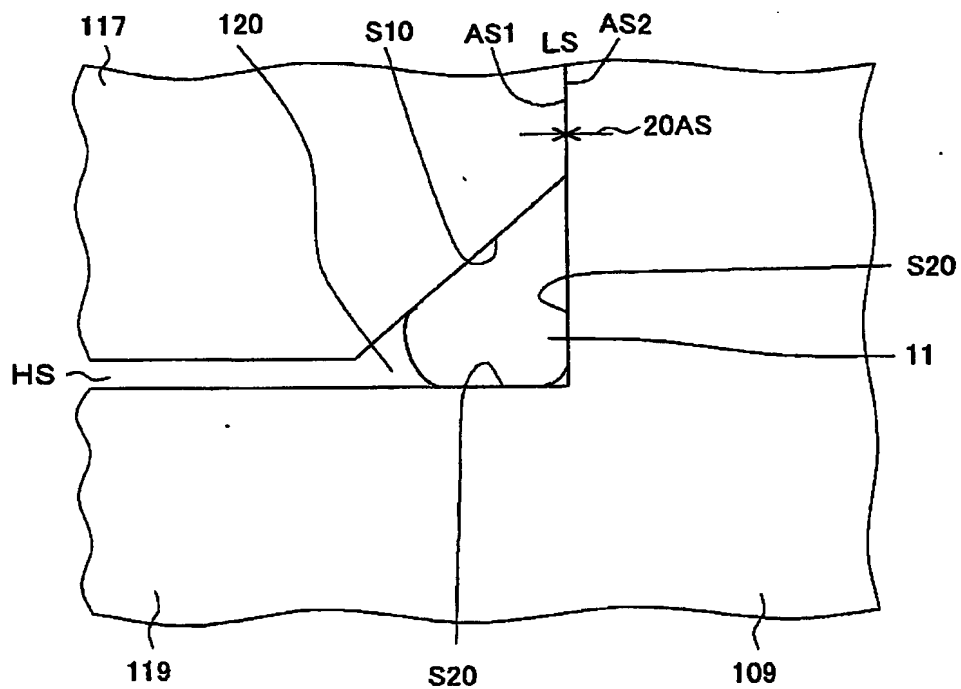
【図 5】



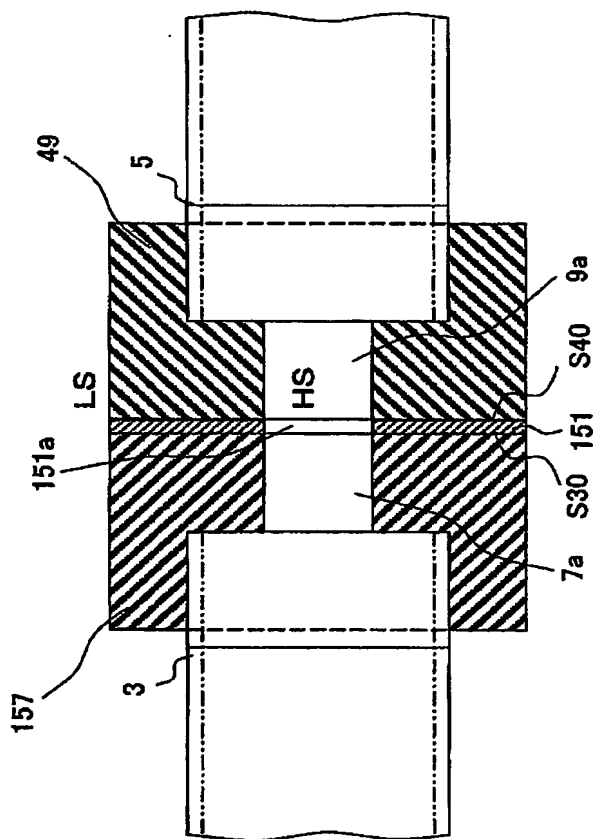
【図 6】



【図 7】

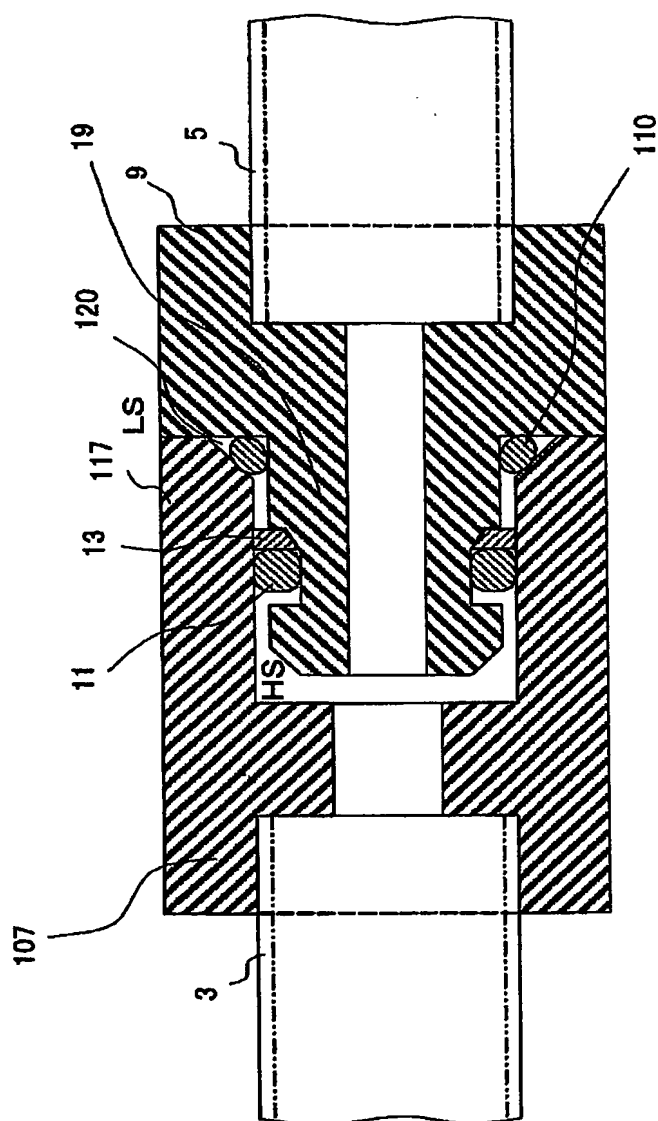


【図 8】

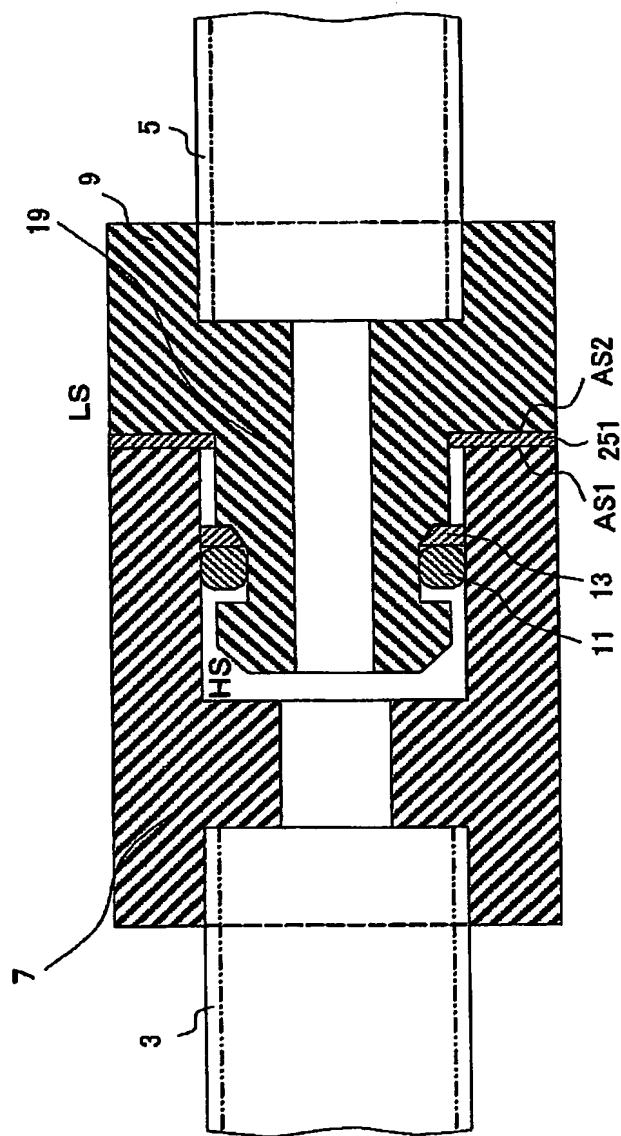


150

【図 9】

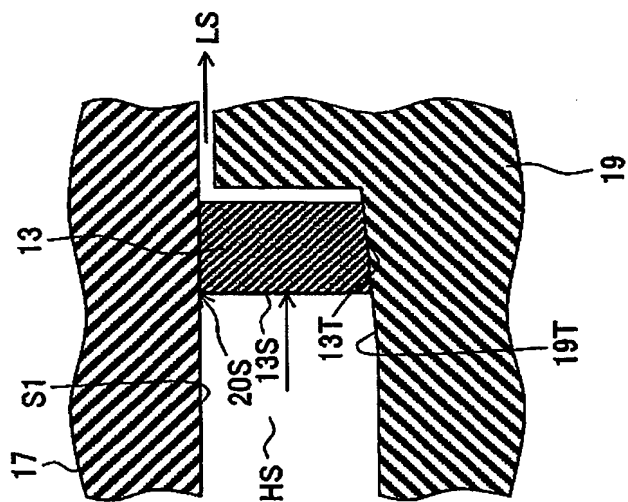


【図 10】

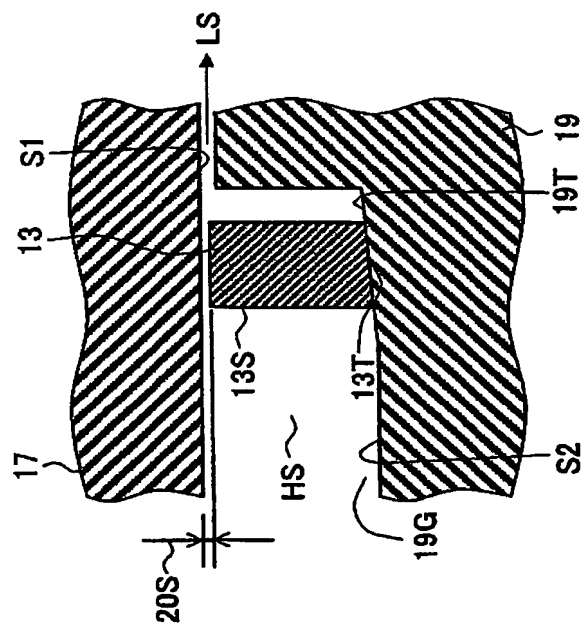


250

【図 11】



(b)



(a)

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ガスがシール部材を透過し易い状態においても、汎用的なシール部材を用いて、連結される部材の間を簡単かつ効果的にシールすることが可能な密封装置を提供する。

【解決手段】 密封装置としての接続装置 1 は、加圧されたガスを流す流路 7 a, 9 a を備え、互いに連結される第 1 および第 2 の接続部材 7, 9 と、接続部材 7, 9 の被シール面 S1, S2 間をシールする O リング 11 と、O リング 11 よりもガスが透過しにくい材料により形成され、接続部材 7, 9 の内部と外部との間の圧力差を受ける O リング 11 を支持する支持面 13 S を有するバックアップリング 13 と、バックアップリング 13 の装着位置における被シール面 S1, S2 の間の距離が、ガスの非加圧側に向かって漸次減少するテーパ面 19 T とを有する。

【選択図】 図 1

【書類名】 出願人名義変更届
【提出日】 平成15年 8月25日
【あて先】 特許庁長官殿
【事件の表示】
【出願番号】 特願2003- 29196
【承継人】
【識別番号】 000004260
【氏名又は名称】 株式会社デンソー
【代表者】 岡部 弘
【承継人代理人】
【識別番号】 100094053
【弁理士】
【氏名又は名称】 佐藤 隆久
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 014890
【納付金額】 4,200円

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2003-029196
受付番号	50301399494
書類名	出願人名義変更届
担当官	本多 真貴子 9087
作成日	平成 15 年 10 月 6 日

<認定情報・付加情報>

【承継人】

【識別番号】	000004260
【住所又は居所】	愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地
【氏名又は名称】	株式会社デンソー

【承継人代理人】	申請人
----------	-----

【識別番号】	100094053
【住所又は居所】	東京都台東区柳橋 2 丁目 4 番 2 号 創進国際特許事務所

【氏名又は名称】	佐藤 隆久
----------	-------

【書類名】 手続補足書
【提出日】 平成15年 8月25日
【あて先】 特許庁長官殿
【事件の表示】
【出願番号】 特願2003- 29196
【補足をする者】
【識別番号】 000004260
【氏名又は名称】 株式会社デンソー
【代理人】
【識別番号】 100094053
【弁理士】
【氏名又は名称】 佐藤 隆久
【補足対象書類名】 出願人名義変更届
【補足の内容】 承継人であることを証する書面および委任状を提出します。
【提出物件の目録】
【物件名】 承継人であることを証する書面 1
【物件名】 委任状 1

【物件名】

承継人であることを証する書面

【添付書類】

譲渡証書

/  190

平成15年 8月20日

一部譲受人

住所 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地
氏名 株式会社デンソー
代表者 岡部 弘 殿

一部譲渡人

住所 東京都港区芝大門1丁目12番15号
氏名 NOK株式会社
代表者 鶴 正 登



下記記載の特許出願に関する特許を受ける権利の一部を貴殿に譲渡したことに
相違ありません。

記

1. 特許出願番号 特願2003-29196
2. 発明の名称 密封装置および接続装置

【物件名】

委任状

【添付書類】

/  190

委 任 状

平成 15 年 6 月 9 日

私は、識別番号 100094053 弁理士 佐藤隆久氏を以て代理人として下記事項を委任します。

記

1. 特願 2003-29196 号に関する手続
1. 上記出願に基づく特許法第 41 条第 1 項又は実用新案法第 8 条第 1 項の規定による優先権の主張及びその取下げ
1. 上記出願に関する出願の変更、出願の放棄及び出願の取下げ
1. 上記出願に関する拒絶査定に対する審判の請求
1. 上記出願に関する補正の却下の決定に対する審判の請求
1. 上記出願に係る特許に対する特許異議の申立てに関する手続
1. 上記各項の手続に関する請求の取下げ、申請の取下げ又は申立ての取下げ
1. 上記各項に関し行政不服審査法に基づく諸手続をなすこと
1. 上記各項の手続を処理するため、復代理人を選任及び解任すること



住 所

名 称

(または氏名)

代表者

カリヤシロウワチョウ
愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地

株式会社 デ ン ソ ー

代表者 岡 部 弘



認定・付加情報

特許出願の番号	特願2003-029196
受付番号	20301610190
書類名	手続補足書
担当官	本多 真貴子 9087
作成日	平成15年10月 3日

<認定情報・付加情報>

【補足をする者】

【識別番号】	000004260
【住所又は居所】	愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地
【氏名又は名称】	株式会社デンソー

【代理人】 申請人

【識別番号】	100094053
【住所又は居所】	東京都台東区柳橋2丁目4番2号 創進国際特許事務所

【氏名又は名称】	佐藤 隆久
----------	-------

【提出された物件の記事】

【提出物件名】	委任状（代理権を証明する書面）	1
【提出物件名】	承継人であることを証する書面	1

特願 2003-029196

出願人履歴情報

識別番号 [000004385]

1. 変更年月日 1990年 8月27日
[変更理由] 新規登録
住 所 東京都港区芝大門1丁目12番15号
氏 名 エヌオーケー株式会社
2. 変更年月日 2003年 7月 4日
[変更理由] 名称変更
住 所 東京都港区芝大門1丁目12番15号
氏 名 NOK株式会社

特願 2003-029196

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000004260]

1. 変更年月日

1996年10月 8日

[変更理由]

名称変更

住 所

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地

氏 名

株式会社デンソー

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record.**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.